



ArF 液浸スキャナー

NSR-S635E

Proven Solutions Through Evolution



重ね合わせ精度・スループットを向上させた 業界最高水準の最先端プロセス量産用ArF液浸スキャナー

ArF液浸スキャナーNSR-S635E

NSR-S635Eは高機能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」を搭載することで重ね合わせ精度とスループットを同時に向上させた、最先端プロセス量産用に開発された**Streamalign Platform**採用のArF液浸スキャナーです。

これにより、NSR-S635Eは装置間重ね合わせ精度 (MMO: Mix and Match Overlay) 2.1 nm以下、スループット毎時275枚以上 (96 shots) という極めて高い精度と生産性を実現しています。

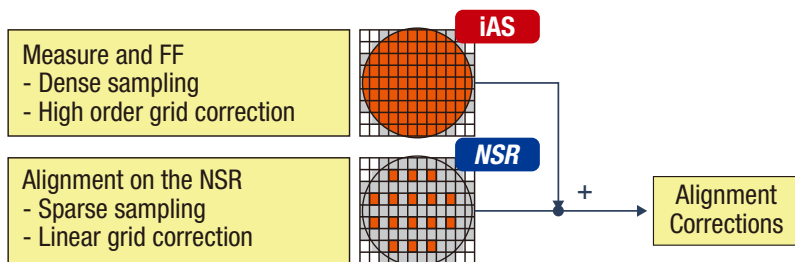
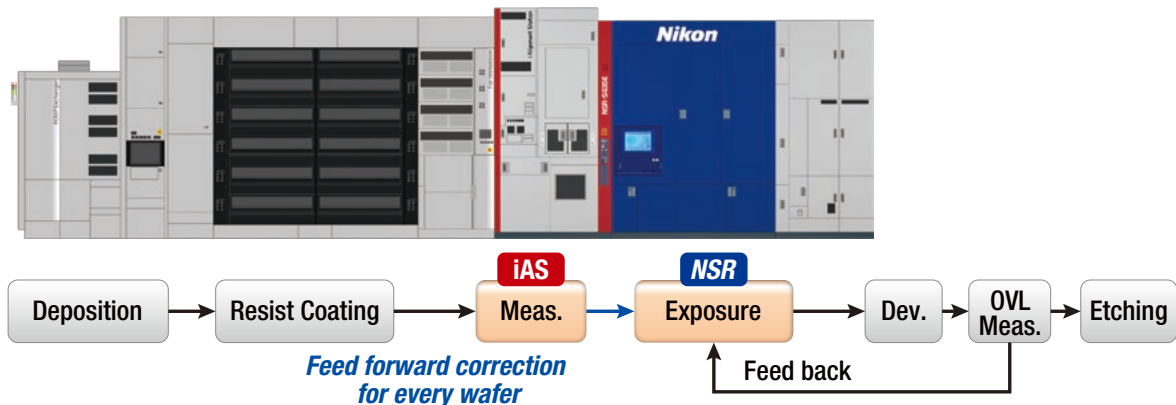
Performance

解像度	≤ 38 nm
NA	1.35
露光光源	ArF excimer laser (193 nm wavelength)
縮小倍率	1:4
最大露光範囲	26 mm × 33 mm
重ね合わせ精度	SMO ^{*1} : ≤ 1.5 nm, MMO ^{*2} : ≤ 2.1 nm
スループット	≥ 275 wafers/hour (96 shots)

*1 Single Machine Overlay: 同一号機間の重ね合わせ精度 (例 NSR-S635E#1 to S635E#1)

*2 Mix and Match Overlay: 同一機種間の重ね合わせ精度 (例 NSR-S635E#1 to S635E#2)

高機能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」の特長



アライメントステーションとは、露光装置のスループットを落とすことなく高速・高精度にウェハを計測し、グリッドエラーの補正を可能にするシステムです。これをインラインで露光装置内に組み込んだものがiASになります。iASにより、スループットを低下させることなく、全ショットでの多点アライメントが可能になり、飛躍的な精度向上を実現しました。

クラス1レーザ製品



安全に関するご注意

■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご注意

本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(特定技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

●このカタログは2023年4月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。

●このカタログに掲載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

©2023 NIKON CORPORATION

株式会社 **ニコン**

精機事業本部 商品戦略部 108-6290 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C 棟 電話(03)6433-3639

株式会社ニコンテック 140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル 電話(03)5762-8911

<https://semi.nikon.com/>